

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 6 部門第 1 区分  
 【発行日】令和 3 年 6 月 17 日 (2021.6.17)

【公表番号】特表 2020-518812 (P2020-518812A)  
 【公表日】令和 2 年 6 月 25 日 (2020.6.25)  
 【年通号数】公開・登録公報 2020-025  
 【出願番号】特願 2019-560104 (P2019-560104)  
 【国際特許分類】

G 0 1 N 21/47 (2006.01)

G 0 1 N 21/57 (2006.01)

【F I】

G 0 1 N 21/47 Z

G 0 1 N 21/57

【手続補正書】  
 【提出日】令和 3 年 4 月 28 日 (2021.4.28)

【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

微小散乱測定システムであって、

400 nm ~ 700 nm の範囲の少なくとも 1 つの波長の光を提供する光源と、

集光素子と、

試料ホルダと、

開口と、

ユーセントリックポイントを中心に回転可能な第 1 の光検出器と、を順番に備え、

前記光源にエネルギーを与えると、前記光源からの光ビームが、前記集光素子を通過し、前記集光素子によって、前記第 1 の光検出器の前記ユーセントリックポイントに集束された 1 平方マイクロメートル ~ 625 平方マイクロメートルの範囲の面積を有するスポットに集束され、前記集束された光が、前記焦点の後方で発散し、発散光が、前記第 1 の光検出器に接触する前に前記開口を通過し、前記試料ホルダは、前記入射光ビームと直交する平面内で移動可能である、微小散乱測定システム。

【請求項 2】

微小散乱測定方法であって、

光源と、

集光素子と、

400 nm ~ 700 nm の範囲の少なくとも 1 つの波長の光に対して、透過性又は反射性のうちの少なくとも一方である試料と、

開口と、

ユーセントリックポイントを中心に回転可能な第 1 の光検出器と、を順番にを備えるシステムを提供することと、

前記光源にエネルギーを与えて、400 nm ~ 700 nm の範囲の少なくとも 1 つの波長の光を有する光ビームを提供することと、その際に、前記光源からの前記光ビームが、前記集光素子を通過し、前記集光素子によって、1 平方マイクロメートル ~ 625 平方マイクロメートルの範囲の面積を有する前記試料上又は前記試料内のいずれかのスポットに集束され、前記試料ホルダが、前記入射光ビームと直交する平面内で移動し、少なくとも

前記光の一部が、前記試料を通して透過されるか、又は前記試料によって反射され、これにより散乱光が提供され、

前記第 1 の光検出器を前記ユーセントリックポイントを中心に回転することと、

前記開口を通過して前記第 1 の光検出器に到達する前記散乱光によって生成されたデータを収集することと、を含む、方法。